

	English	中文	交通アクセス・地図	お問い合わせ	サイトマップ	サイト内検索
	受験生の方	広大へ留学希望の方	一般・地域の方	企業の方	卒業生の方	在学生・保護者の方

大学案内

入試情報

教育・学生生活

研究

社会連携

留学・国際交流

学部・大学院等

研究所・施設等

広報・報道

採用情報

校友会・同窓会

支援財団・基金

図書館・博物館等

大学病院

附属学校

[トップページ](#) > [広報・報道](#) > [報道発表・報道された広島大学](#) > [平成20年1月-12月](#) > 半導体専門実践講座の説明会・模擬授業の開催について

半導体専門実践講座の説明会・模擬授業の開催について

広島大学学長室広報グループ

〒739-8511 東広島市鏡山 1-3-2

TEL:082-424-6017 FAX:082-424-6040

E-mail:koho@office.hiroshima-u.ac.jp

(*※@は半角に置き換え送信してください。)

NEWS RELEASE



平成20年3月5日

4月から社会人等のための「半導体専門実践講座」がスタート
3月13日に説明会と模擬授業を開催

広島大学などで行く半導体関連産業製造中核人材育成コンソーシアム(プロジェクトコーディネーター:広島大学大学院先端物質科学研究科 教授 岩田 穆)は、本年4月から開設する「半導体専門実践講座」の説明会と模擬授業を、下記のとおり開催します。

この半導体専門実践講座は、同コンソーシアムが、平成17年度から19年度の3年間、経済産業省の委託を受けて開発した講座です。

コンソーシアムでは、実習を主体にしたカリキュラムや教材の開発に取り組み、実証講義も昨年8月から12月にかけて実施しました。この成果をもとに、本年4月からは、広島大学大学院先端物質科学研究科の半導体集積科学専攻内に「半導体専門実践教育プログラム」を、また、社会人対象に「半導体専門実践講座」を開設する予定です。

記

日 時: 平成20年3月13日(木) 13時～17時30分
会 場: 広島大学東千田キャンパス 東千田総合校舎206講義室(2階)
対 象: 半導体関連企業の経営者、人材教育担当者の方、教育関係者、学生等
定 員: 80名(参加無料)

*模擬授業の内容、半導体専門実践講座の開設科目は別紙のとおりです。

【お問い合わせ先】
広島大学学術部 中核人材育成事業担当 遠部(おんべ)
TEL:082-424-5172

広大公式アカウント一覧

 Twitter

 Facebook
(日本語版)

 Facebook
(英語版)

 YouTube

 行事カレンダー

 ストリートビュー

 キャンパスカメラ

 学内ポータル



ご案内

半導体専門 実践講座 説明会

主催：半導体関連産業製造中核人材育成コンソーシアム
(管理法人 広島大学)
後援：中国地域産学官コラボレーションセンター

趣旨：半導体関連産業の技術者養成のための半導体専門実証講座を開講のため受講方法の説明を行います。多数のご参加をお願いします。

日時：平成20年3月13日（木）
13時～17時30分

会場：広島大学東千田総合校舎 A棟2階206講義室
(広島市中区東千田町1-1-89)

対象：半導体関連企業の経営者，人材教育担当者の方
教育関係者，学生，興味のある方

定員：80名（参加無料）

プログラム

13:00 挨拶・概要説明 岩田 穆

模擬授業

13:15-13:55 『集積システム開発（メカトロ）』 三枝 省三

13:55-14:25 『プリント基板の低電磁雑音設計』 古賀 隆治

14:25-14:45 『デジタル上位設計・設計検証手法』 弘中 哲夫

(休憩)

15:00-15:30 『高速デジタルインタフェース及びアナログ・RF回路の設計と測定』 岩田 穆

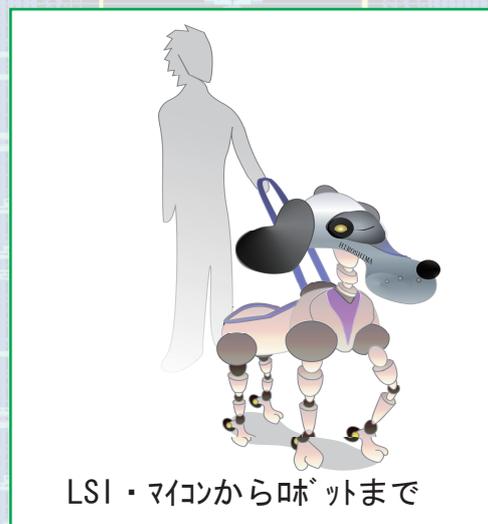
15:30-16:10 『IC設計作成評価基礎及び集積システム序論』 田中 武

16:10-16:30 『半導体製造プロセスにおける分析・評価技術』 宮崎 誠一

16:30-17:00 『LSI製造要素プロセス基礎編及びLSI製造プロセス応用編』 横山 新

Q&A・質問・要望

17:00-17:30 開講スケジュール，受講方法，費用等



LSI・マイコンからペットまで



お問い合わせ・お申し込み先は裏面をご参照ください。

開設科目のご案内

全13科目開講。各科目は半分以上が実習であり座学と実習の組み合わせにより、学習の意欲が向上します。

● 半導体専門実践講座には養成する人材のタイプ、LSI製造技術者、LSI設計技術者、LSI応用システム開発技術者に対応して、科目Ⅰ、Ⅱ、Ⅲを組み合わせる3つのコースを用意しており、修了者には認定証を授与します。●

【科目Ⅰ】LSIプロセス・デバイス

- ・ LSI製造要素プロセス基礎編
- ・ LSI製造プロセス応用編
- ・ 半導体製造プロセスにおける分析・評価技術
- ・ IC設計作成評価基礎 <広島工業大学で開講>

【科目Ⅱ】LSI設計

- ・ デジタル上位設計・設計検証手法 <実習のみ：>
- ・ 高速デジタルインタフェース設計 <広島市立大学で開講>
- ・ アナログ回路の設計
- ・ アナログ回路の測定
- ・ RF回路の設計と測定

【科目Ⅲ】LSI応用システム

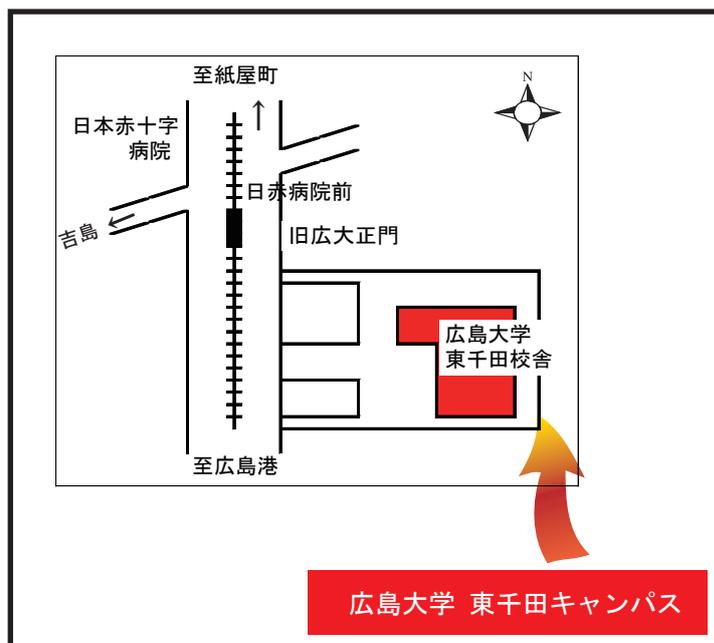
- ・ 集積システム序論 <広島工業大学で開講>
- ・ 集積システム開発（メカトロシステム）
- ・ 先端複合実装技術
- ・ プリント基板の低電磁雑音設計

【参画団体】

広島大学、岡山大学、広島市立大学、広島工業大学
エルピーダメモリ(株)、シャープ(株)LSI事業本部、
(株)トッパン・テクニカル・デザインセンター、
ローツェ(株)、(株)エイアールテック



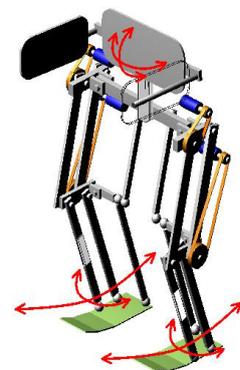
会場案内図



アクセス

JR広島駅 又は
広島バスセンター（紙屋町）から
市内電車 紙屋町経由
広島港（宇品）行（1番）
日赤病院前下車
広島駅から約30分
バスセンターから約15分

歩行支援 ロボット



- 詳細掲示 ホームページ：
http://www.vbl.hiroshima-u.ac.jp/vbl_hp/

お問合せ先・参加申込書

FAX : 082-424-6990

E-mail : gakujutu-project@office.hiroshima-u.ac.jp

管理人：国立大学法人 広島大学 学術部内
中核人材育成事業担当 遠部（おんべ）
電話 082-424-5172, 5726 FAX: 082-424-6990
住所 東広島市鏡山1-1-1 〒739-8524

ふりがな
氏名

所属

連絡先 住所・Tel :

e-mail :

* 個人情報の取り扱いについて、広島大学の規則に基づき十分注意を払い取り扱います。

当日でも結構ですが、準備の都合上 締め切り：平成20年3月10日（月）までをお願いします。